

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-284295

(43)Date of publication of application : 13.10.2000

(51)Int.Cl.

G02F 1/1339

G02F 1/13

G02F 1/1333

G09F 9/30

(21)Application number : 11-089612

(71)Applicant : HITACHI TECHNO ENG CO LTD

(22)Date of filing : 30.03.1999

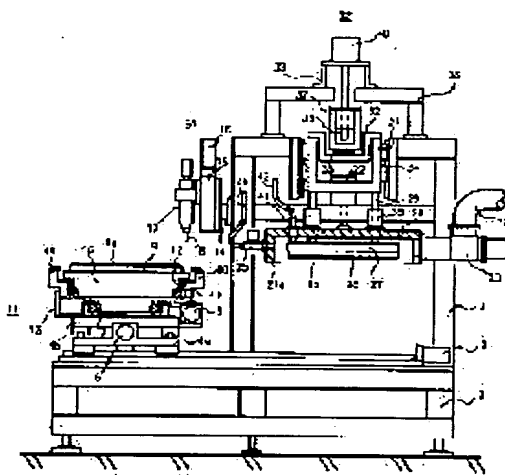
(72)Inventor : HACHIMAN SATOSHI  
IMAIZUMI KIYOSHI  
SAITO MASAYUKI  
KAWASUMI YUKIHIRO  
SANKAI HARUO  
HIRAI AKIRA

## (54) METHOD AND APPARATUS FOR ASSEMBLING SUBSTRATE

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To bond substrates which are approximately the same to each other with high accuracy in a vacuum even if the substrate size increases and the thickness thereof is reduced.

SOLUTION: Electrostatic attraction force is acted on an upper substrate 1b from a pressurizing plate 27 and the upper substrate 1b is held on the pressurizing plate 27 and is bonded thereto in the vacuum. Further, the upper substrate 1b is held on the pressurizing plate 27 by suction attraction force and the electrostatic attraction force is acted on the upper substrate 1b accepted in the position of the extent slight apart from the pressurizing plate 27 dropped when the suction attraction force disappears in the process of progressing the pressure reduction, by which the upper substrate 1b is again held on the pressurizing plate 27 and the bonding in the vacuum is executed.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.04.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

**BEST AVAILABLE COPY**

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3410983

[Date of registration]

20.03.2003

[Number of appeal against examiner's decision  
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開 2000-284295

(P 2000-284295A)

(43) 公開日 平成12年10月13日 (2000. 10. 13)

| (51) Int. Cl. 7 | 識別記号         | F I     | テーマコード* (参考)       |
|-----------------|--------------|---------|--------------------|
| G 0 2 F         | 1/1339 5 0 5 | G 0 2 F | 1/1339 5 0 5 2H088 |
|                 | 1/13 1 0 1   |         | 1/13 1 0 1 2H089   |
|                 | 1/1333 5 0 0 |         | 1/1333 5 0 0 2H090 |
| G 0 9 F         | 9/30         | G 0 9 F | 9/30 C 5C094       |
|                 | 3 1 0        |         | 3 1 0              |
| 審査請求            | 未請求          | 請求項の数 5 | OL (全 6 頁)         |

(21) 出願番号 特願平11-89612

(22) 出願日 平成11年3月30日 (1999. 3. 30)

(71) 出願人 000233077

日立テクノエンジニアリング株式会社  
東京都足立区中川四丁目13番17号

(72) 発明者 八幡 聡

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ  
クノエンジニアリング株式会社開発研究所内

(72) 発明者 今泉 潔

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ  
クノエンジニアリング株式会社開発研究所内

(74) 代理人 100059269

弁理士 秋本 正実

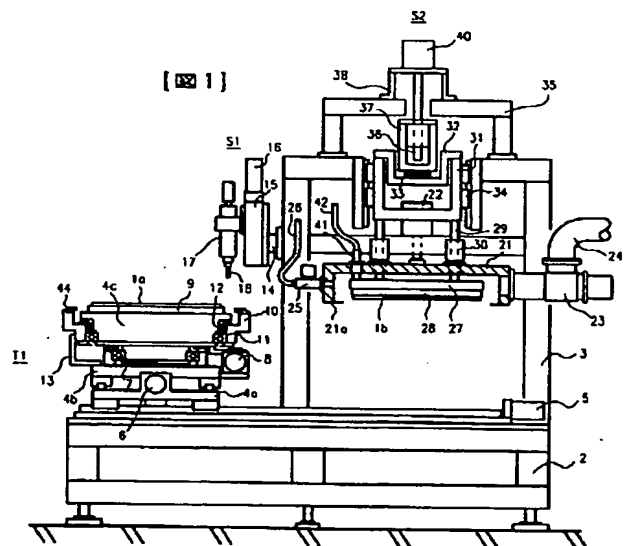
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 基板の組立方法およびその装置

(57) 【要約】

【課題】 基板サイズが大型化、薄板化しても真空中で高精度に同程度の基板同士を貼り合わせることが可能な基板の組立方法およびその装置を提供することである。

【解決手段】 加圧板から上基板に静電吸着力を作用させて加圧板上に上基板を保持させて真空中で貼り合わせを行う。さらには、上基板を加圧板に吸引吸着力で保持させ、減圧を進める過程で吸引吸着力が消えた時に落下し加圧板から僅かに離れた程度の位置に受け止められた上基板に静電吸着力を作用させて、再度加圧板上に上基板を保持させて真空中で貼り合わせを行なう。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 貼り合わせる一方の基板を加圧板の下面に保持し、貼り合わせる他方の基板をテーブル上に保持して対向させ、いずれかの基板に設けた接着剤により真空中で間隔を狭めて貼り合わせる基板の組立方法において、

加圧板から一方の基板に静電吸着力を作用させて一方の基板を加圧板に保持させて貼り合わせを行うことを特徴とする基板の組立方法。

【請求項 2】 貼り合わせる一方の基板を加圧板の下面に保持し、貼り合わせる他方の基板をテーブル上に保持して対向させ、いずれかの基板に設けた接着剤により真空中で間隔を狭めて貼り合わせる基板の組立方法において、

一方の基板を加圧板に大気中で吸引吸着力によって保持させ、減圧を進める過程で吸引吸着力が消えて落下する一方の基板を加圧板から僅かに離れた程度の位置に受け止めて、この一方の基板に加圧板から静電吸着力を作用させて加圧板に一方の基板を保持させて貼り合わせを行なうことを特徴とする基板の組立方法。

【請求項 3】 貼り合わせる一方の基板を加圧板の下面に保持し、貼り合わせる他方の基板をテーブル上に保持して対向させ、いずれかの基板に設けた接着剤により真空中で間隔を狭めて貼り合わせる基板の組立方法において、

一方の基板を加圧板に大気中で吸引吸着力によって保持させるとともに押し当てておき、減圧を進める過程で吸引吸着力が消える前後でこの一方の基板に加圧板から静電吸着力を作用させて加圧板に一方の基板を引き続き保持させて貼り合わせを行なうことを特徴とする基板の組立方法。

【請求項 4】 真空チャンバ内の上方に位置する加圧板の下面に貼り合わせる一方の基板を保持し、貼り合わせる他方の基板を真空チャンバ内の下方に位置するテーブル上に保持して両基板を対向させ、いずれかの基板に設けた接着剤により真空中で両基板の間隔を狭めて基板同士を貼り合わせる基板の組立装置において、加圧板に一方の基板を吸引吸着力で保持させる手段と静電吸着力で保持させる手段を設け、真空チャンバ内の減圧を進める過程で吸引吸着力が消えた時に落下する一方の基板を加圧板から僅かに離れた程度の位置に受け止める手段あるいは加圧板に一方の基板を押し付ける手段を設け、この受け止め手段あるいは押し付ける手段上に一方の基板があるときに少なくとも静電吸着力を作用させて加圧板に一方の基板を保持させる手段を設けたことを特徴とする基板の組立装置。

【請求項 5】 真空チャンバ内の上方に位置する加圧板の下面に貼り合わせる一方の基板を保持し、貼り合わせる他方の基板を真空チャンバ内の下方に位置するテーブル上に保持して両基板を対向させ、いずれかの基板に設

た接着剤により真空中で両基板の間隔を狭めて基板同士を貼り合わせる基板の組立装置において、

テーブルは真空チャンバの内外間を水平に移動できるのであり、真空チャンバの外に位置したテーブル上の他方の基板に接着剤を閉鎖したパターンに描画する手段と、テーブル上における他方の基板上の接着剤の閉鎖したパターン内に液晶を滴下する手段を設け、加圧板に一方の基板を吸引吸着力で保持させる手段と静電吸着力で保持させる手段を設け、真空チャンバ内の減圧を進める過程で吸引吸着力が消えた時に落下する一方の基板を加圧板から僅かに離れた程度の位置に受け止める手段あるいは加圧板に一方の基板を押し付ける手段を設け、この受け止め手段あるいは押し付ける手段上に一方の基板があるときに少なくとも静電吸着力を作用させて加圧板に一方の基板を保持させる手段を設けたことを特徴とする基板の組立装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、真空チャンバ内で貼り合わせる基板同士をそれぞれ保持して対向させ真空中で間隔を狭めて貼り合わせる基板の組立方法とその装置に関する。

## 【0002】

【従来の技術】 液晶表示パネルの製造には、透明電極や薄膜トランジスタアレイを付けた 2 枚のガラス基板を数  $\mu\text{m}$  程度の極めて接近した間隔をもって接着剤（以下、シール剤ともいう）で貼り合わせ（以後、貼り合せ後の基板をセルと呼ぶ）、それによって形成される空間に液晶を封止する工程がある。

【0003】 この液晶の封止には、注入口を設けないようにシール剤をクローズしたパターンに描画した一方の基板上に液晶を滴下しておいて他方の基板を一方の基板上に配置し真空中で上下の基板を接近させて貼り合わせる特開昭 62-165622 号公報で提案された方法や、一方の基板上に注入口を設けるようにシール剤をパターン描画して真空中で基板の貼り合わせ後にシール剤の注入口から注入する特開平 10-26763 号公報で提案された方法などがある。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】 上記従来技術では、シール剤のパターン描画の前後に係わらず、いずれも両基板は真空中で貼り合わせている。真空中では、大気状態時のように、基板を大気との圧力差で吸引吸着することができない。

【0005】 上側に位置する基板（以下、上基板と呼ぶ。）の端部を機械的に保持すると基板の中央部がたわみ、そのたわみは最近の基板大型化、薄板化傾向が強まるにつれて大きくなっている。

【0006】 上下各基板の周縁端部に設けた位置合わせマークを利用して位置決めを行うため、たわみが大きい

程両基板の端部同士の間隔は拡がり位置合わせができな  
い。

【0007】更に、上基板のたわみで上基板の中央部が  
周縁部よりも先に下側の基板（以下、下基板と呼ぶ。）  
に接触するので、基板間隔を一定にする為に基板間に散  
布されているスペーサが動き、基板上に形成されている  
配向膜などを傷つけてしまう。

【0008】実際には貼り合わせる上下の基板は同サイズ  
なので、保持代がほとんど取れない状態にある。

【0009】それゆえ本発明の目的は、基板サイズが大  
型化、薄板化しても真空中で高精度に同程度の基板同士  
を貼り合わせることが可能な基板の組立方法およびその装  
置を提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発  
明の特徴とするところは、加圧板から上基板に静電吸着  
力を作用させて加圧板に上基板を保持させて真空中で貼  
り合わせを行うことにある。

【0011】さらには、上基板を加圧板に大気中で吸引  
吸着力で保持させ、減圧を進める過程で吸引吸着力が消  
えた時に落下する上基板を加圧板から僅かに離れた程度  
の位置に受け止めて、この上基板に加圧板から静電吸着  
力を作用させて、再び加圧板に上基板を保持させて真空  
中で貼り合わせを行なうことにある。

【0012】

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態を図に  
基づいて説明する。

【0013】図1乃至図3において、本発明になる基板  
組立装置は、液晶滴下部S1と基板貼合部S2から構成  
され、この両部分は架台2上に隣接して配置される。架  
台2の上方には基板貼合部S2を支持するフレーム3が  
ある。また、架台2の上面には、XYθステージT1が  
備えられている。Xステージ4aは、駆動モータ5によ  
り、図面上で左右のX軸方向に、即ち、液晶滴下部S1  
と基板貼合部S2間を往来できるようになっている。Y  
ステージ4bはXステージ4a上にあり、駆動モータ6に  
よりXステージと直交するY軸方向に往来できるよう  
になっている。θステージ4cはYステージ4b上にあり、  
回転ベアリング7を介して駆動モータ8によりYステー  
ジ4bに対して水平に回転可能になっていて、θステー  
ジ4c上に基板を搭載するテーブル9が固定される。ま  
た、Yステージ4bにプレート13で下チャンバ10が  
固定されている。θステージ4cは、下チャンバ10に  
対し回転ベアリング11と真空シール12を介して軸A  
を回転中心として回転自由に取付けられ、θステージ4  
cが回転しても下チャンバ10はつられて回転しない構  
造としている。

【0014】液晶滴下部S1は、テーブル9に保持され  
た下基板1aに所望量の液晶剤を滴下するためのフレー  
ム3から突出したブラケット14で支持されたディス

ンサ17とこれを上下移動させるためのZ軸ステージ1  
5とそれを駆動するモータ16で構成される。下基板1  
aをテーブル9上に保持搭載したXYθステージT1  
は、液晶剤を滴下するディスペンサ17のノズル18に  
対し、XおよびY方向に移動する。これにより、下基板1  
a上の任意の個所に所望量の液晶剤が滴下される。

【0015】液晶滴下後の下基板1aを搭載保持したX  
YθステージT1は基板貼合部S2の下部に駆動モータ  
5によって移動する。

【0016】基板貼合部S2では、上チャンバ21とそ  
の内部の静電吸着板28がそれぞれ独立して上下動でき  
る構造になっている。即ち、上チャンバ21は、リニア  
プッシュと真空シールを内蔵したハウジング30を有し  
ており、シャフト29をガイドとしてフレーム2に固定  
されたシリンダ22により上下のZ軸方向に移動する。

【0017】XYθステージT1が基板貼合部S2に移  
動して上チャンバ21が下降すると、下チャンバ1  
0の周りに配置してあるOリング44に上チャンバ21  
のフランジが接触し一体となり、この時真空チャンバと  
して機能する状態になる。

【0018】Oリング44のつぶれ量は、上チャンバ2  
1の下降停止位置を調整し、真空チャンバ内を真空に保  
つことができ、かつ、最大の弾性が得られる程度に設定  
する。

【0019】ハウジング30は、上チャンバ21が下チ  
ャンバ10と真空チャンバを形成して変形しても、シャ  
フト29に対し真空漏れを起こさないで上下動可能な真  
空シールを内蔵しているので、真空チャンバの変形がシ  
ャフト29に与える力を吸収することができ、シャフト  
29に固定され静電吸着板28を保持した加圧板27の  
変形がほぼ防止でき、後述するように静電吸着板28に  
保持された上基板1bとテーブル9に保持された下基板  
1aとの平行を保って貼り合わせが可能となる。

【0020】23は真空バルブ、24は配管ホースで図  
示していない真空源に接続され、これらは真空チャンバ  
を減圧し真空にする時に使用される。また、25はガス  
パージバルブ、26はガスチューブで、N<sub>2</sub>やクリーン  
ドライエアー等の圧力源に接続され、これらは真空チャン  
バを大気圧に戻す時に使用される。

【0021】上基板1bは静電吸着板28の下面に密着  
保持されるが、大気下において上基板1bは吸引吸着で  
静電吸着板28に保持されるようになっている。即ち、  
41は吸引吸着用継手、42は吸引チューブであり、図  
示していない真空源に接続され、静電吸着板28面  
には、それにつながる複数の吸引孔が設けられている。

【0022】尚、周りが大気の場合、静電吸着を併用し  
てもよいし、静電吸着力が大きい場合は、吸引吸着を不  
要としてもよい。

【0023】静電吸着板28はシャフト29で支持され  
た加圧板27に取付けられており、シャフト29はハウ

ジング 31、32 に固定されている。ハウジング 31 はフレーム 2 に対してリニアガイド 34 で取付けられ、静電吸着板 28 は上下動可能な構造になっている。その上下駆動はフレーム 2 とつながるフレーム 35 上のブラケット 38 に固定されたモータ 40 により行う。駆動の伝達にはボールねじ 36 とナットハウジング 37 で実行される。ナットハウジング 37 は荷重計 33 を介してハウジング 32 とつながり、その下部の静電吸着板 28 と一体で動作する。

【0024】従って、モータ 40 によってシャフト 29 が下降し、上基板 1b を保持した静電吸着板 28 が下降し上基板 1b がテーブル 9 上の下基板 1a と密着して、加圧力を与えることのできる構造となっている。この場合、荷重計 33 は加圧力センサとして働き、逐次、フィードバックされた信号を基にモータ 40 を制御することで、上下基板 1a、1b に所望の加圧力を与えることが可能となっている。

【0025】下基板 1a は重力方向の搭載なので、図 2 に示すようにテーブル 9 に設けた位置決め部材 81 に押付ローラ 82 による水平方向での押付けによる位置決めの固定で十分であるが、貼り合わす直前の微小位置決めの際、上基板 1b が下基板 1a 上のシール剤や液晶剤と接触した影響で下基板 1a がずれたり持ち上がる可能性があることや真空チャンバ内が減圧され真空になる過程で下基板 1a とテーブル 9 との間に入り込んでいる空気が逃げて下基板 1a が踊りずれる可能性があるため、テーブル 9 に対しても静電吸着の機能を持たせても良い。そして、テーブル 9 に上下 Z 軸方向に移動できるピンを設け接地しておく、基板貼り合わせ後のセルの帯電防止とテーブル 9 からのセル取り外しを容易に行なうことができる。

【0026】図 2 に示す 60 は、静電吸着板 28 が吸引吸着をしていて真空チャンバが減圧され吸引吸着力が消えて上基板 1b が落下するとき静電吸着板 28 の僅か下の位置で受け止める受止爪で、上基板 1b の 2 個の対角の位置にあって下方に伸びたシャフト 59 で釣り下げた形に支持されている。具体的には、図 3 に示すように、シャフト 59 は上チャンバ 21 のハウジング 58 を介して真空シールされて回転と上下移動ができるようになっている。即ち、シャフト 59 は、シャフト 29 に設けたブラケット 63 に固定された昇降アクチュエータ 62 でシャフト 29 の上下移動とは独立してさらに上下に移動できるだけでなく、回転アクチュエータ 61 によって回転できるようになっている。

【0027】次に、基板を吸着する静電吸着板 28 について説明する。

【0028】静電吸着板 28 は絶縁物の板であり、方形の凹部を 2 個有していて、各凹部に内蔵された平板電極を誘電体で覆ってその誘電体の主面が静電吸着板 28 の下面と同一平面になっている。埋め込まれた各平板電極

はそれぞれ正負の直流電源に適宜なスイッチを介して接続されている。

【0029】従って、各平板電極に正あるいは負の電圧が印加されると、静電吸着板 28 の下面と同一平面になっている誘電体の主面に負あるいは正の電荷が誘起され、それら電荷によって上基板 1b の透明電極膜との間に発生するクーロン力で上基板 1b が静電吸着される。各平板電極に印加する電圧は同極でもよいしそれぞれ異なる双極でもよい。

【0030】次に、本基板組立装置で基板を貼り合わせる工程について説明する。

【0031】先ず、テーブル 9 に上基板 1b を保持した治具を搭載し、駆動モータ 5 で XYθ ステージ T1 を基板貼合部 S2 に移動させる。そこでモータ 40 によりシャフト 29 を介して加圧板 27 や静電吸着板 28 を降下させ、テーブル 9 上の上基板 1b を吸引吸着させてから、モータ 40 で上昇させて、上基板 1b を待機状態とする。

【0032】XYθ ステージ T1 は液晶滴下部 S1 に戻って、空になった治具が外されテーブル 9 上に下基板 1a が搭載され、図 2 に示すように所望位置に固定保持される。

【0033】図 1 には示していないが、フレーム 3 にシール剤を吐出するデイスペンサがあって、XYθ ステージ T1 の各モータ 5、6 で下基板 1a を XY 軸方向に移動させつつシール剤を吐出させると、下基板 1a 上にクローズ（閉鎖）したパターンでシール剤を描画できる。その後、デイスペンサ 17 から液晶剤を下基板 1a 上に滴下する。この場合、シール剤がダムとなって、滴下した液晶剤は流失することはない。

【0034】次に、XYθ ステージ T1 を基板貼合部 S2 に移動させ、シリンダ 22 で上チャンバ 21 を降下させ、そのフランジ部 21a をオリング 44 に当接させて下チャンバ 10 と真空チャンバを形成させる。そして、真空バルブ 23 を開放して真空チャンバ内が減圧していく。この時、上基板 1b は静電吸着板 28 に吸引吸着された状態になっているので、減圧が進み真空化していくと上基板 1b に作用していた吸引吸着力は消えて行き、上基板 1b が自重で落下する。これを図 2 に示すように受止爪 60 で受け止めて、図 3 に示すように静電吸着板 28 の僅か下の位置に保持しておく。

【0035】真空チャンバ内が充分真空になった時点で、静電吸着板 28 に電圧を印加して受止爪 60 上の上基板 1b を、静電吸着板 28 にクーロン力で吸引保持する。この場合、既に真空になっているので、静電吸着板 28 と上基板 1b の間に空気が残るようなことは無いし、その空気が逃げるときに上基板 1b が踊ることもない。より重要なことは空気を介在させることなく、静電吸着板 28 に上基板 1b が密着していることである。そのため、誘起電荷で放電を発生することがない。

【0036】空気を残したまま放電を生じると空気が膨張し、上基板 1b を静電吸着板 28 から剥離させたり薄ガラス製の上基板 1b を破壊することがあるが、本実施形態によれば空気が存在しないので、そのような異常事故は発生しない。

【0037】その後、昇降アクチュエータ 62 でシャフト 59 を下降させ、次に、回転アクチュエータ 61 でシャフト 59 を回転させ、受止爪 60 が上下両基板の貼り合わせの邪魔にならぬようにしてから、モータ 40 で加圧板 27 を降下させ、荷重計 33 で加圧力を計測しつつモータ 40 を制御して上下両基板 1a, 1b を所望間隔に貼り合わせる。

【0038】この場合、上基板 1b は静電吸着板 28 に密着していて中央部が垂れ下がっていることはないから、液晶剤中のスペーサに悪影響を与えたり、基板同士の位置合わせが不可能になることはない。因みに、位置合わせは図示を省略した上チャンバ 21 に設けた覗き窓から画像認識カメラで上下各基板 1a, 1b に設けられている位置合わせマークを読み取って画像処理により位置を計測し、XYθステージ T1 の各ステージ 4a 乃至 4c を微動させて、高精度な位置合わせを行なう。

【0039】貼り合わせが終了すると、真空バルブ 23 を締めてガスパージバルブ 25 を開き、真空チャンバ内に N<sub>2</sub> やクリーンドライエアーを供給し、大気圧に戻してからガスパージバルブ 25 を閉じて、シリンダ 22 で上チャンバ 21 を上昇させ、XYθステージ T1 を液晶滴下部 S1 に戻して、テーブル 9 からセルを外し次の貼り合わせに備える。ここで、貼合後のセルは帯電している場合があるので、接地した除電バーに接触させたりイオン風を吹き当てるなどの除電処理をしてから、テーブル 9 からセルを外すと良い。テーブル 9 から外したセルは下流の UV 光照射装置や加熱装置などでシール剤が硬化される。

【0040】以上の実施形態では、シール剤を吐出して液晶を滴下し直ちに貼り合せに移行するので、基板が塵埃を受けづらく生産歩留まりを向上できる。また、XYθステージ T1 を上基板 1b の真空チャンバ内への搬送に利用でき、装置の小型化が図られている。

【0041】本発明は以上説明した実施形態に限らず、以下の様に実施しても良い。

【0042】(1) 上基板 1b の静電吸着板 28 への供給は、XYθステージ T1 に上下方向に伸縮可能な複数の受止爪 (図 2 の受止爪 60 相当のもの) を設けておいて、XYθステージ T1 が液晶滴下部 S1 にあるときにその複数の受止爪上に上基板 1b を載せて、XYθステージ T1 を基板貼合部 S2 に移動させるようにしてもよい。

【0043】(2) また、ロボットハンドから直接静

電吸着板 28 に吸引吸着をしてよい。

【0044】(3) 上記 (1) で説明した XYθステージ T1 に設けた受止爪で、減圧が進む際に落下する上基板 1b を受け止めるようにしてもよい。

【0045】(4) さらに、図 2 の受止爪 60 や上記 (1) で説明した XYθステージ T1 に設けた受止爪で、上基板 1b が落下する前に上基板 1b を静電吸着板 28 に押し付けておいて、静電吸着板 28 に吸引吸着された状態から減圧を進めて、静電吸着に切替えてもよい。この場合、物理的に上基板 1b が静電吸着板 28 に密着しているということがないようにしておくことで、上基板 1b と静電吸着板 28 の間の空気を減圧とともに真空化することができる。

【0046】(5) さらにまた、図 2 の受止爪 60 や上記 (1) で説明した XYθステージ T1 に設けた受止爪で、上基板 1b を静電吸着板 28 から僅かに離れた位置に保持しておいて、吸引吸着をしないで減圧を進める途中で静電吸着を行なってもよい。

【0047】(6) また、図 2 では受止爪 60 により上基板 1b の 2 個の角部 (対角を構成する 2 隅) を保持しているが、上基板 1b の 4 個の角部 (4 隅) を保持したり、上基板 1b の 4 辺あるいは長手方向の 2 辺または幅方向の 2 辺を適宜な手段で保持するようにしてもよい。

【0048】

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、基板サイズが大型化、薄板化しても真空中で高精度に同程度の基板同士を貼り合わせることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の一実施形態を示す基板組立装置の概略図である。

【図 2】上下の各基板を貼り合わせるときの状況を示す斜視図である。

【図 3】上基板に静電吸着力を作用させ上下両基板を貼り合わせる直前の状況を示す要部の断面図である。

【符号の説明】

S2 基板貼合部

1a 下基板

1b 上基板

9 テーブル

10 下チャンバ

21 上チャンバ

23 真空バルブ

27 加圧板

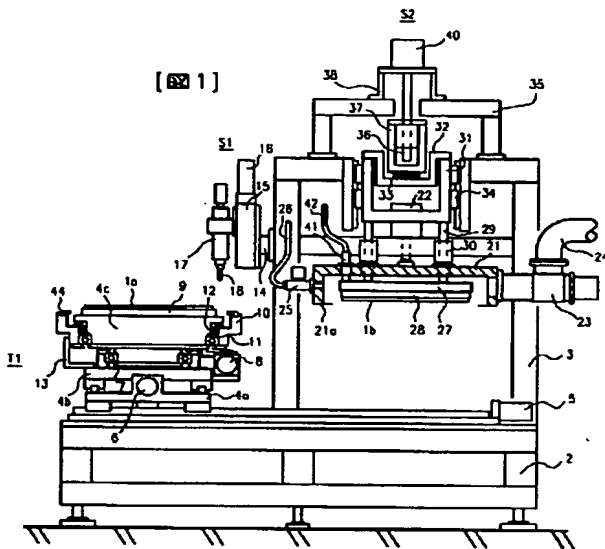
28 静電吸着板

59 シャフト

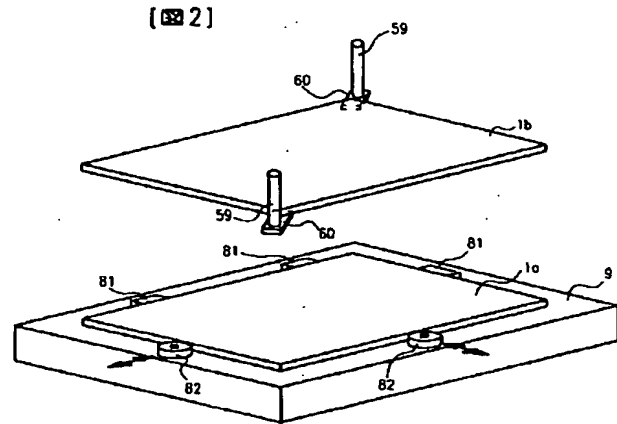
61 回転アクチュエータ

62 昇降アクチュエータ

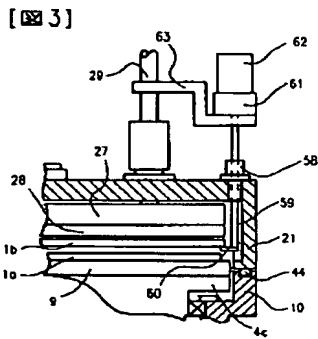
【図 1】



【図 2】



【図 3】



フロントページの続き

(72)発明者 齊藤 正行  
茨城県竜ヶ崎市向陽台 5 丁目 2 番 日立テ  
クノエンジニアリング株式会社開発研究所  
内

(72)発明者 川隅 幸宏  
茨城県竜ヶ崎市向陽台 5 丁目 2 番 日立テ  
クノエンジニアリング株式会社開発研究所  
内

(72)発明者 三階 春夫  
茨城県竜ヶ崎市向陽台 5 丁目 2 番 日立テ  
クノエンジニアリング株式会社開発研究所  
内

(72)発明者 平井 明  
茨城県竜ヶ崎市向陽台 5 丁目 2 番 日立テ  
クノエンジニアリング株式会社開発研究所  
内

F ターム(参考) 2H088 FA01 FA10 FA16 FA30 HA01  
2H089 NA49 NA60 QA11  
2H090 JC12 LA02  
5C094 AA14 AA42 AA43 AA55 BA43  
GB01



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.